

# 残留応力を測定

## シリコン ウエハー向け 近赤外歪検査器

ルケオ

ルケオ（東京都板橋区、吉村健太郎社長）は、シリコンウエハーの残留応力などを測定する近赤外歪検査器「フルオートストレインアイルSM-910 OWNIR II写真」を発売した。近赤外光で有色樹脂成形品などの非透明素材を透過し、

30ナノ30000ナノの歪みを捉える。消費税抜きの価格は1台800万円。半導体や樹脂成形品のメーカーなど向けに初年度12台の販売を目指す。

従来は偏光板2枚で検査対象を挟んで歪みを捉える際、可視光を利用していた。このため、対象は光学レンズやガラス、透明樹脂成形品などに限られていた。そこで、900ナノ1200ナノ間で波長の異なる二つの近赤外光と回転角度で歪みを算出する方式を開発し、新製品で採用した。



量産品としては同社最大級となる直径100ミリの偏光板の安定生産に成功した。大型化で有効測定サイズは直径100ミリと広く

などの大型対象物で画像のつなぎ目をきれいに補正できるようにした。サイズは幅300ミリ×奥行き353ミリ×高さ540ミリ。

なり、1分以下の短時間でカメラを使った面一括測定を可能にした。画像処理ソフトも改良し、12色のシリコンウエハー